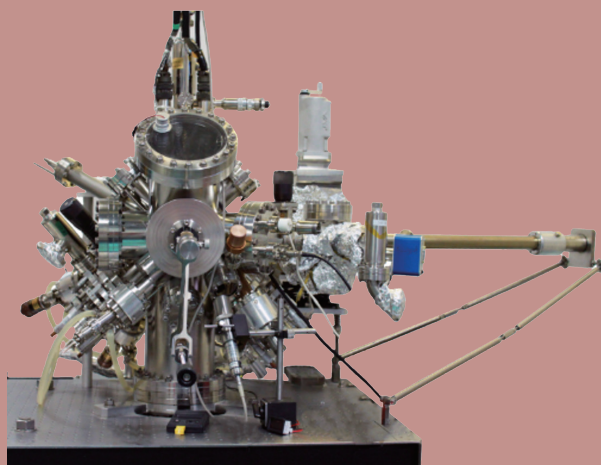
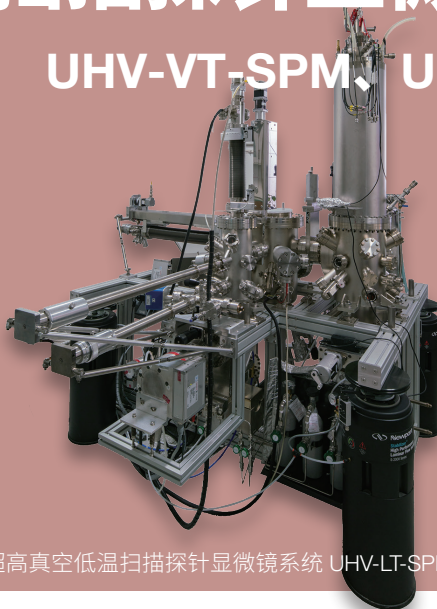


超高真空扫描探针显微镜系统

UHV-VT-SPM、UHV-LT-SPM



超高真空变温扫描探针显微镜系统 UHV-VT-SPM



超高真空低温扫描探针显微镜系统 UHV-LT-SPM



性能指标

超高真空变温扫描探针显微镜系统

- 本地真空： $\leq 3 \times 10^{-10}$ mbar
- 工作温度范围：8—290 K
- 分辨率：原子分辨
- 低温恒温器类型：持续流
- 冷却时间： ~ 2 h
- 液氮消耗率：1.0 L/h

超高真空低温扫描探针显微镜系统

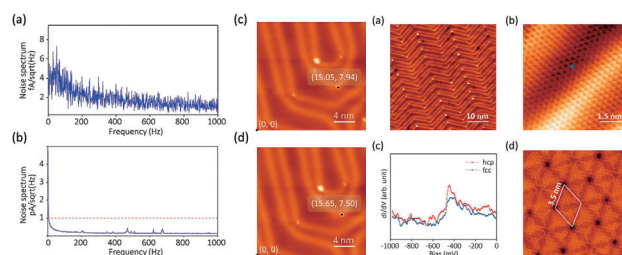
- 本底真空： $\leq 3 \times 10^{-10}$ mbar
- 最低工作温度： ≤ 5 K
- 可集成 MBE(最多 6 个蒸发源)
- 新型潘式 STM+qPlus AFM 探针头
- 分辨率：原子分辨
- 低温保持时间 ≥ 60 小时 (4L 液氮)

主要应用

表面科学，超薄膜层，有机分子层，二维原子晶体，单原子磁性

代表性应用成果

该超高真空低温扫描探针显微镜系统的详细介绍发表在《科学仪器评论》杂志 (Review of Scientific Instruments 89, 113705 (2018); doi: 10.1063/1.5046466)。



部分系统性能测试数据

主要用户单位	清华大学、中山大学、中国科学院物理研究所、国家纳米科学中心、中国科学院大学
研制单位	中国科学院物理研究所
联系方式	郇老师 010-82649096, 18910279533 huanq@iphy.ac.cn